

일반가스의 취급 현황

김인환
(주) 명 신 가 스

The present statue of general gas treatment in Korea

In-Hwan Kim
MYUNG SIN GAS CO.,LTD

1. 서론

가스의 정의

압축가스 : 상용의 온도, 35℃에서 압력이 10kg/cm²g 이상이며, 상온에서 압축해도 액화하기 어려운 가스

액화가스 : 상용의 온도, 35℃에서 압력이 2kg/cm²g 이상이며, 상온에서 압축하면 쉽게 액화되는 가스

용해가스 : 상용의 온도에서 압력이 0kg/cm²g 이상이며, 용기에 다공물질의 고체를 충전하고 용제를 주입하여 이것에 가스를 고압 상태로 용해시킨 아세틸레가스 등이 있다.

가스의 특성

가연성 가스(Flammable gas) : 폭발범위 하한이 10% 이하이거나 상한과 하한의 차이가 20% 이상인 가스

독성 가스(Toxic gas) : 성인 남자가 1일 8시간 근무 시 인체에 해를 기치지 않는 농도(허용농도가 200ppm 이하인 가스)

부식성 가스(Corrosive gas) : 다른 물질과 화학반응을 일으켜 물질 조직을 파괴시키거나 금속 등에 부식을 일으키는 가스

불연성 가스(No-flammable gas) : 스스로 연소하지는 않으나 산소의 고갈로 인해 질식사의 원인이 된다.

조연성(지연성)가스(Oxidizer gas) : 다른 가연성 물질의 연소 시 연소를 도와준다.

일반가스의 물성

가스명	분자량	비중 (Air=1)	성질	허용농도 (ppm)	인체에의 작용도	색.냄새	폭발범위
Argon	39.95	0.38	不				
Helium	4.00	0.138	不				
Hydrogen	2.02	0.069	燃				4-75
Krypton	83.80	2.89	不				
Neon	20.18	0.695	不				
Nitrogen	28.01	0.967	不				
Oxygen	32.00	1.105	支				
Xenon	131.30	4.53	不				
Ammonia	17.03	0.597	燃.毒	25	자극성	무색	15-28
Arsine	77.95	2.695	燃.毒	0.05	두통,구토	무색,마늘	LFL5.8
Boron Trichloride	117.17	4.10	毒.腐	5		무색,플냄 새	
Boron Trifluoride	67.81	2.38	毒.腐	1	자극성	무색	
Carbon Monoxide	44.01	1.521	燃.毒	25	질식성	무색,무취	120.5-74.2
Carbon Dioxide	28.01	0.965	不	5000			
Carbon Tetrafluoride	88.00	3.05	不				
Chlorine	70.91	2.474	毒.腐	0.5	자극성	황록색	
Diborane	27.67	0.95	燃.毒	0.5	두통,구토	무색	0.9-98
Dichlorosilane	101.01	3.51	燃.毒	5	자극성	무색	4.1-98.8
Difluoromethane	52.02	1.79	不				
Disiane	62.12	2.26	燃.毒	5			unknown
Germane	76.62	2.645	燃.毒	0.2		무색	unknown
Hexafluoroethane	138.01	4.823	不				
Hydrogen Bromide	80.91	2.812	毒.腐	3	자극성	무색	
Hydrogen Chloride	36.46	1.268	毒.腐	5	자극성	무색	
Hydrogen Selenide	80.98	2.80	燃.毒	0.05		무색	unknown
Hydrogen Sulfide	34.08	1.189	燃.毒	10	구토	계란냄새	4-44
Methane	16.04	0.555	燃				5-15.4
Methyl Fluoride	34.03	1.17	燃				
Methylsilane	46.12	1.59	燃				
Nitrogen Trifluoride	71.00	2.49	毒.毒	10		무색	
Nitric Oxide	30.01	1.037	毒	25			
Nitrous Oxide	44.01	1.530	支.痲		마취성		
Octafluorocyclobutane	200.03	6.89	不				
Pentafluoroethane	120.02	4.13	不				
Perfluoropropane	188.02	6.64	不				
Phosphine	34.00	1.146	燃.毒	0.3	구토,두통	무색,마늘	unknown
silane	32.12	1.12	燃.毒	5			0.8-98
Silicon Tetrachloride	169.90	5.86	腐				
Silicon Tetrafluoride	104.08	3.36	毒.腐	3	자극성	무색	
Sulfur Hexafluoride	146.05	5.11	不	1000			
Trichlorosilane	135.45	4.67	燃.毒.腐	3			7-83
Trimethylsilane	74	2.55	燃	5			
Trifluoromethane	70.01	2.417	不				

(注) 燃腐 : 可燃性. 支 : 支燃性. 毒 : 毒性 腐 : 腐蝕性. 痲 : 痲醉性. 不 : 不活性

반도체 공정에 사용되는 Gas

공정명	G A S 명
Diffusion	HCl, H ₂ , O ₂ , POCl ₃
LP CVD	SiH ₄ , SiCl ₂ , H ₂ , NH ₃ , N ₂ O, N ₂
CVD	SiH ₄ , B ₂ H ₆ , PH ₃ , WF ₆ , SiCl ₂ H ₂ , HF, Si ₂ H ₆
Dry Etch	NF ₃ , BCl ₃ , CH ₃ Cl, CHF ₃ , C ₂ F ₆ , CF ₄ , SF ₆ , SiCl ₄
Ion Imp.	AsH ₃ , PH ₃
Sputter	Ar